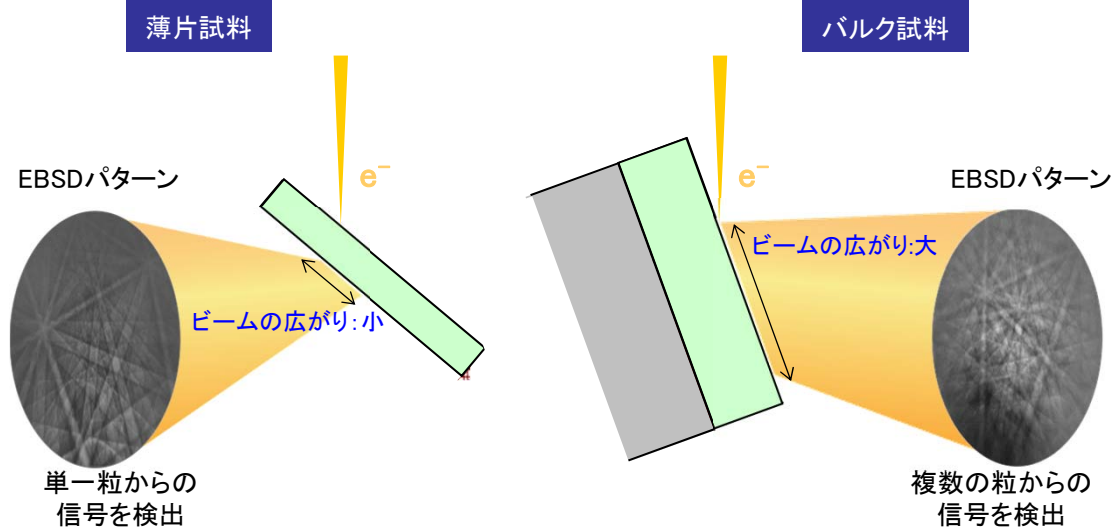


透過EBSD法による30nm以下の結晶粒解析

EBSD：電子後方散乱回折法

透過EBSD法による空間分解能の向上

薄片化した試料でEBSD分析を行うことにより、従来のバルク試料よりも高い空間分解能を得ることができます。*

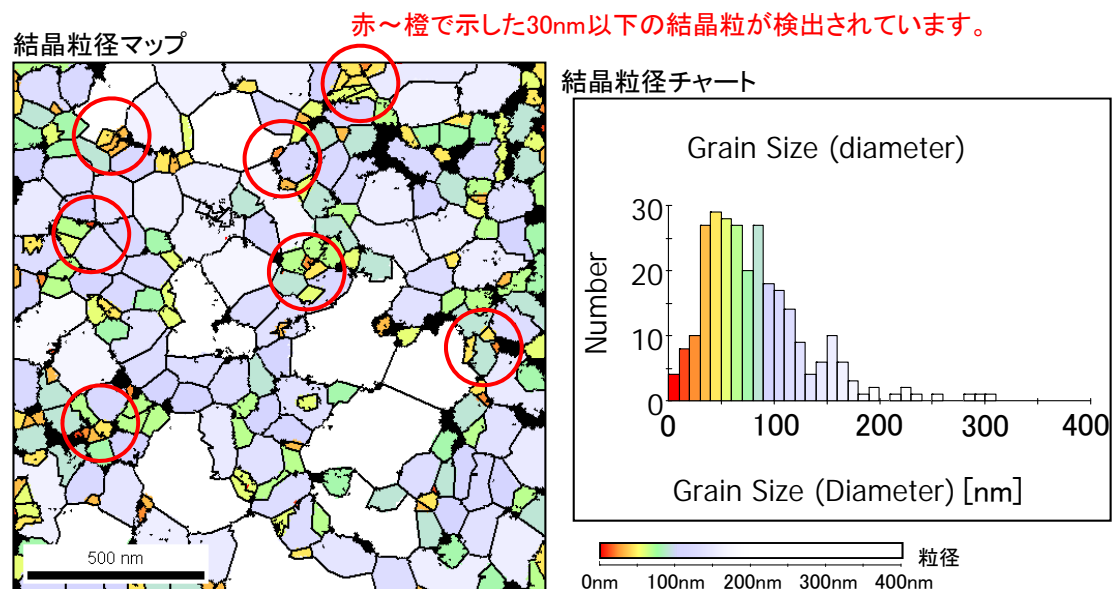


※)引用： R. R. Keller, R.H. Geiss : "Transmission EBSD from 10 nm domains in a scanning electron microscope", Journal of Microscopy, Vol. 245, Pt 3 2012, pp. 245-251

分析事例

■ Cu膜のEBSD測定

薄片化することにより、これまで測定が難しかった10~30nmの小さい結晶粒の検出が可能となっています。



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp

URL : <http://www.mst.or.jp/>